

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2555743

### УСТРОЙСТВО СВЧ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

Патентообладатель(ли): *Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук (ИСВЧПЭ РАН) (RU)*

Автор(ы): *см. на обороте*

Заявка № 2013132994

Приоритет изобретения 17 июля 2013 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 09 июня 2015 г.

Срок действия патента истекает 17 июля 2033 г.

Врио руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Л.Л. Кирий

